

JP04/10622

PCT/JP2004/010622

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

02.8.2004

REC'D 24 SEP 2004

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2003年 7月31日

出願番号  
Application Number: 特願2003-204196  
[ST. 10/C]: [JP2003-204196]

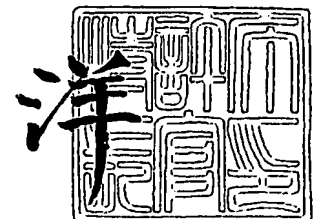
出願人  
Applicant(s): シャープ株式会社

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月 9日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川



出証番号 出証特2004-3080962

【書類名】 特許願

【整理番号】 03J02353

【提出日】 平成15年 7月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 F24C 1/00

【発明の名称】 蒸気調理器

【請求項の数】 7

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

    【氏名】 安藤 有司

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

    【氏名】 入江 敏之

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

    【氏名】 上田 真也

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

    【氏名】 梅本 昌見

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

    【氏名】 木村 忠信

## 【特許出願人】

【識別番号】 000005049  
【氏名又は名称】 シャープ株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100085501  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 佐野 静夫

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100111811  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 山田 茂樹

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100121256  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 小寺 淳一

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 024969  
【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0208726

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 蒸気調理器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 以下の構成を備えた蒸気調理器：

- (a) 被加熱物を入れる加熱室
- (b) 蒸気発生装置
- (c) 前記加熱室の天井部に設けられ、前記蒸気発生装置から蒸気が供給されるとともに、蒸気を加熱室に噴出する複数の噴気孔を分散配置したサブキャビティ
- (d) 前記サブキャビティ内の気体を加熱する加熱手段。

【請求項 2】 前記加熱室に設けられた気体吸込口と前記サブキャビティとを連絡する外部循環路と、前記気体吸込口からサブキャビティへと向かう気流を前記外部循環路内に形成する送風装置とを備えることを特徴とする請求項 1 に記載の蒸気調理器。

【請求項 3】 被加熱物を入れる加熱室に蒸気発生装置にて発生した蒸気を供給するようにして成る蒸気調理器において、

前記蒸気発生装置から供給された蒸気を前記加熱室に噴出する複数の噴気孔を分散配置したサブキャビティを加熱室天井部に設けるとともにこのサブキャビティ内の気体を加熱する加熱手段を設け、

前記加熱室内の気体を前記サブキャビティに還流させる外部循環路を設けるとともに還流を加熱する送風装置を設けたことを特徴とする蒸気調理器。

【請求項 4】 前記外部循環路の気体吸込口が、前記加熱室の側壁に配置されていることを特徴とする請求項 2 に記載の蒸気調理器。

【請求項 5】 前記気体吸込口が、前記加熱室側壁の下部に配置されていることを特徴とする請求項 4 に記載の蒸気調理器。

【請求項 6】 前記噴気孔が前記加熱室天井部の中央部に配置されていることを特徴とする請求項 1～5 のいずれか 1 項に記載の蒸気調理器。

【請求項 7】 前記サブキャビティには、前記加熱手段を構成するヒータを内蔵させるとともに、前記噴気孔を有する底面パネルを設け、この底面パネルの色を上下両面とも暗色としたことを特徴とする請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載

の蒸気調理器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は蒸気調理器に関する。

【0002】

【従来の技術】

蒸気を用いて加熱調理を行う蒸気調理器については、これまでも数々の提案がなされている。その例を特許文献1及び2に見ることができる。特許文献1には食品トレイの中に蒸気を噴射する蒸気調理装置が記載されている。特許文献2には過熱蒸気をオープン庫に送り込む、あるいはオープン庫内の蒸気を輻射加熱によって過熱蒸気にする加熱調理装置が記載されている。

【0003】

【特許文献1】

実開平3-67902号公報

【特許文献2】

特開平8-49854号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

特許文献1記載の蒸気調理装置は、複数の食品トレイに蒸気供給管から蒸気を供給する業務用の装置である。この構成は、加熱室内に蒸気供給管がむき出しになっているので視覚的に好ましくなく、家庭用の調理器には適さない。また蒸気の噴射範囲は蒸気供給管の形状によって制約を受け、加熱室内の食品（被加熱物）に均等に蒸気を噴きつけるのは難しい。

【0005】

特許文献2記載の加熱調理装置は、蒸気を被加熱物に向けて噴射するのでなく、蒸気で被加熱物を包み込んで加熱調理する構成であり、大量の熱を速やかに被加熱物に与えるには物足りないものである。

【0006】

本発明は上記の点に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、家庭で使用するのに適した視覚的に好ましい蒸気調理器であって、被加熱物に大量の熱を均一かつ速やかに与えることができ、加熱効率の高い蒸気調理器を提供することにある。補足すると、本発明は、加熱室全体を加熱するのではなく、被加熱物を重点的に加熱することを基本概念とする。

#### 【0007】

##### 【課題を解決するための手段】

(1) 本発明蒸気調理器は以下の構成を備える：

- (a) 被加熱物を入れる加熱室
- (b) 蒸気発生装置
- (c) 前記加熱室の天井部に設けられ、前記蒸気発生装置から蒸気が供給されるとともに、蒸気を加熱室に噴出する複数の噴気孔を分散配置したサブキャビティ
- (d) 前記サブキャビティ内の気体を加熱する加熱手段。

#### 【0008】

この構成によれば、蒸気を含む気体が噴き出すのは加熱室の天井部に設けられたサブキャビティの噴気孔であり、蒸気供給のための配管系統が加熱室内にむき出しにならないので、家庭用の調理器として視覚的に好ましいものになる。また蒸気は分散配置された複数の噴気孔から被加熱物に向け下向きに噴出するので、被加熱物の上面全体に蒸気が衝突する。蒸気が被加熱物に衝突することと、衝突の面積が広いことが相まって、蒸気に含まれる熱が素早く効率的に被加熱物に伝達される。また、サブキャビティに入り込んだ蒸気が加熱手段で熱せられて膨張することにより、噴出の勢いが増し、被加熱物への衝突速度が速まる。これにより被加熱物は一層速やかに熱せられる。

#### 【0009】

下向きに吹き出した蒸気は、被加熱物に衝突した後、上方へと向きを転じる。蒸気、特に過熱蒸気は空気より軽いため、自然な形でこのように方向転換することとなり、これが加熱室の内部に対流をもたらす。この対流により、加熱室内の温度を維持しつつ、被加熱物にはサブキャビティで熱せられたばかりの蒸気を衝突させ続けることができ、熱を大量且つ速やかに被加熱物に与えることができる

## 【0010】

(2) 上記のような蒸気調理器において、前記加熱室に設けられた気体吸込口と前記サブキャビティとを連絡する外部循環路と、前記気体吸込口からサブキャビティへと向かう気流を前記外部循環路内に形成する送風装置とを備えるものとした。

## 【0011】

この構成によれば、サブキャビティから噴出した蒸気は気体吸込口から外部循環路を通してサブキャビティに戻ることであり、蒸気を一方通行で噴射し続けるのと異なり、大能力の蒸気発生装置を必要としない。従って家庭内での使用が可能である。蒸気を垂れ流しにしないのでエネルギー効率も高い。

## 【0012】

(3) また本発明では、被加熱物を入れる加熱室に蒸気発生装置にて発生した蒸気を供給するようにして成る蒸気調理器において、前記蒸気発生装置から供給された蒸気を前記加熱室に噴出する複数の噴気孔を分散配置したサブキャビティを加熱室天井部に設けるとともにこのサブキャビティ内の気体を加熱する加熱手段を設け、前記加熱室内の気体を前記サブキャビティに還流させる外部循環路を設けるとともに還流を加勢する送風装置を設けた。

上記「前記蒸気発生装置から供給された蒸気」は実施の形態のように外部循環路を経由するほか、直接、サブキャビティに供給することが考えられる。

## 【0013】

この構成によれば、蒸気を含む気体が噴き出すのは加熱室の天井部に設けられたサブキャビティの噴気孔であり、蒸気供給のための配管系統が加熱室内にむき出しにならないので、家庭用の調理器として視覚的に好ましいものになる。また蒸気は分散配置された複数の噴気孔から被加熱物に向け下向きに噴出するので、被加熱物の上面全体に蒸気が衝突する。蒸気が被加熱物に衝突することと、衝突の面積が広いことが相まって、蒸気に含まれる熱が素早く効率的に被加熱物に伝達される。また、サブキャビティに入り込んだ蒸気が加熱手段で熱せられて膨張することにより、噴出の勢いが増し、被加熱物への衝突速度が速まる。これに

より被加熱物は一層速やかに熱せられる。

【0014】

下向きに吹き出した蒸気は、被加熱物に衝突した後、上方へと向きを転じる。蒸気、特に過熱蒸気は空気より軽いため、自然な形でこのように方向転換することとなり、これが加熱室の内部に対流をもたらす。この対流により、加熱室内の温度を維持しつつ、被加熱物にはサブキャビティで熱せられたばかりの蒸気を衝突させ続けることができ、熱を大量且つ速やかに被加熱物に与えることができる。

【0015】

さらに、サブキャビティから噴出した蒸気は外部循環路を通してサブキャビティに還流するので、蒸気を一方通行で噴射し続けるのと異なり、大能力の蒸気発生装置を必要としない。従って家庭内での使用が可能である。蒸気を垂れ流しにしないのでエネルギー効率も高い。また蒸気の還流を送風装置が加勢するので、噴気孔から常に勢い良く蒸気が噴出する。

【0016】

(4) 上記のような蒸気調理器において、前記外部循環路の気体吸込口が、前記加熱室の側壁に配置されているものとした。

【0017】

この構成によれば、蒸気は直進して被加熱物に当たってから側壁の気体吸込口に吸い込まれることになり、被加熱物への熱伝達能力は高レベルに維持される。また上から噴出した蒸気が側壁に吸い込まれて行くため、加熱室の扉を開いたとき、使用者の方に蒸気が押し寄せることが少なく、安全性が高い。

【0018】

(5) 上記のような蒸気調理器において、前記気体吸込口が、前記加熱室側壁の下部に配置されているものとした。

【0019】

気体吸込口が上の方にあると、そこに吸い込まれる気体の動きにより、上方から噴出した蒸気の中に、被加熱物に衝突する前に偏向する部分が生じる。これは、被加熱物に当たる蒸気の勢いが弱まる、あるいは被加熱物に当たる蒸気量が



減るといった好ましからざる結果をもたらす。気体吸込口を加熱室の側壁下部（被加熱物の高さ以下）に設けておけば、蒸気は偏向することなく直進して被加熱物に当たってから気体吸込口に吸い込まれることになり、被加熱物への熱伝達能力は高レベルに維持される。また上から噴出した蒸気が側壁下部に吸い込まれて行くため、加熱室の扉を開いたとき、使用者の方に蒸気が押し寄せることが少なく、安全性が高い。

#### 【0020】

（6）上記のような蒸気調理器において、前記噴気孔が前記加熱室天井部の中央部に配置されているものとした。

#### 【0021】

この構成によれば、加熱室の中央部で蒸気の吹き下ろしが生じるとともに、その周囲では蒸気の吹き上げが生じる。すなわち蒸気の流れが自然にしかも効率良く行われ、被加熱物の加熱効率が向上する。

#### 【0022】

（7）上記のような蒸気調理器において、前記サブキャビティには、前記加熱手段を構成するヒータを内蔵させるとともに、前記噴気孔を有する底面パネルを設け、この底面パネルの色を上下両面とも暗色とした。

#### 【0023】

この構成によれば、ヒータの輻射熱がサブキャビティの底面パネルの暗色上面から吸収された後、底面パネルの暗色下面から加熱室に輻射放熱される。このため、サブキャビティ及びその外面の温度上昇が抑制され、安全性が向上するとともに、ヒータの輻射熱が底面パネルを通じて加熱室に伝えられ、被加熱物が一層効率良く熱せられる。

#### 【0024】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明による蒸気調理器の一実施形態を図1～7に基づき説明する。図1は外観斜視図、図2は加熱室の扉を開いた状態の外観斜視図、図3は内部機構の基本構造図、図4は加熱室の上面図、図5は蒸気発生装置の垂直断面図、図6は蒸気発生装置の水平断面図、図7は制御ブロック図である。

## 【0025】

蒸気調理器 1 は直方体形状のキャビネット 10 を備える。キャビネット 10 の正面には、上部に操作パネル 11、その下に扉 12 が設けられる。扉 12 は下端を中心に垂直面内で回転するものであり、上部のハンドル 13 を握って手前に引くことにより、図 1 に示す垂直な閉鎖状態から図 2 に示す水平な開放状態へと 90° 姿勢変換させることができる。扉 12 の大部分は耐熱ガラスをはめ込んだ窓 14 となっている。

## 【0026】

扉 12 を開くと、図 2 に見られるように二つの区画が露出する。左側の大きな区画は加熱室 20、右側の小さな区画は水タンク室 70 である。加熱室 20 と水タンク室 70 の構造、及びこれらに付属する構成要素について、図 3 以下の図を参照しつつ説明する。

## 【0027】

加熱室 20 は直方体形状で、扉 12 に面する正面側は全面的に開口部となっている。加熱室 20 の残りの面及び扉 12 の内面はステンレス鋼板で形成される。加熱室 20 の周囲及び扉 12 の内側にはそれぞれ断熱対策が施される。加熱室 20 の床面にはステンレス鋼板製の受皿 21 が置かれ、受皿 21 の上には被加熱物 90 を載置するステンレス鋼線製のラック 22 が置かれる。

## 【0028】

加熱室 20 の中の気体（通常の場合、加熱室 20 の内部の気体は空気であるが、蒸気調理を始めると空気が蒸気で置き換えられて行く。従って本明細書では「空気」でなく「気体」と表現する）は外部循環路 30 を通って循環する。加熱室 20 の側壁には、これと平行する形で天井面から床面近くまで垂下する気流制御板 23（これもステンレス鋼板製である）が配置されている。この気流制御板 23 の下端と奥の側壁との間の隙間が、外部循環路 30 に気体を導く下向きの気体吸込口 24 となる。

## 【0029】

気体吸込口 24 から吸い込まれた気体は気流制御板 23 の裏を通して加熱室 20 の外側上部に設けられた送風装置 25 へと向かう。送風装置 25 は遠心ファン

26及びこれを収容するファンケーシング27と、遠心ファン26を回転させるモータ（図示せず）を備える。遠心ファン26としてはシロッコファンを用いる。遠心ファン26を回転させるモータには高速回転が可能な直流モータを使用する。

#### 【0030】

ファンケーシング27の吐出口に接続された外部循環路30は断面円形のパイプを組み合わせて構成される。ファンケーシング27からは第1パイプ31が水平方向に突き出す。第1パイプ31の端には排気口32が設けられる。第1パイプ31の排気口32より少し上流にはエルボ形の第2パイプ33が接続される。第2パイプ33の水平部分は蒸気発生装置50（詳細は後述する）の上部に入り込み、蒸気吸引エジェクタ34を形成する。第2パイプ33の吐出端は絞り成形され、蒸気吸引エジェクタ34のインナーノズルとなる。蒸気発生装置50の側面からは蒸気吸引エジェクタ34のアウターノズル35が下流に向かって突出し、その吐出端はノズル形状に絞り成形されている。

#### 【0031】

外部循環路30の第3パイプ36が蒸気吸引エジェクタ34の下流でアウターノズル35のノズル形状吐出端を受け入れる。第3パイプ36の端はアウターノズル35を包むように膨らんでおり、ここに後段エジェクタ37が形成される。蒸気吸引エジェクタ34のアウターノズル35のノズル形状吐出端は、後段エジェクタ37においてはインナーノズルの役割を果たす。後段エジェクタ37には、第1パイプ31から分岐したバイパス路38が接続される。バイパス路38も断面円形のパイプにより形成される。図4に見られるようにバイパス路38は2本設けられ、後段エジェクタ37に左右対称的に気体を吹き込む。

#### 【0032】

第3パイプ36の他端は加熱室20に気体を戻す気体戻し口39となるサブキャビティ40に接続される。サブキャビティ40は加熱室20の天井部の上にて、天井部の中央部にあたる箇所に設けられ、平面形状円形で、その内側には気体の加熱手段である蒸気加熱ヒータ41が配置されている。蒸気加熱ヒータ41はシーズヒータにより構成される。サブキャビティ40の底面は加熱室20の天井

壁となる金属パネル（加熱室 20 の天板と兼用可）で形成され、この底面パネル 42 には複数の噴気孔 43 がほぼパネル全面にわたり二次元的に或いは三次元的に分散配置されている。底面パネル 42 は上下両面とも塗装などの表面処理により暗色に仕上げられている。底面パネル 42 は使用を重ねることにより暗色に変色する金属素材で成形してもよく、暗色のセラミック成型品であってもよい。

#### 【0033】

加熱室 20 の上部の一隅には気体放出口 44 が形成されている。また第 1 パイプ 31 の端には電動式のダンパ 45 が配置される。ダンパ 45 は排気口 32 と第 2 パイプ 33 の入口とを選択的に閉ざす。

#### 【0034】

続いて蒸気発生装置 50 の構造を、図 5、6 を参照しつつ説明する。蒸気発生装置 50 は中心線を垂直にして配置された筒型（円筒形）のポット 51 を備える。ポット 51 の上部は閉じており、前述のように蒸気吸引エジェクタ 34 が形成されている。

#### 【0035】

ポット 51 の底部は漏斗状に成形され、そこから排水パイプ 52 が垂下する。排水パイプ 52 の下端は水平に対しやや勾配をなす形で配置された排水パイプ 53 に接続される。排水パイプ 53 の端は加熱室 20 の側壁を通じ受皿 21 に向かって開口する。排水パイプ 52 の途中には排水バルブ 54 及び水位センサ 55 が設けられている。

#### 【0036】

ポット 51 内の水を熱するのはポット 51 の外面に密着するように設けられた蒸気発生ヒータ 56 である。蒸気発生ヒータ 56 は環状のシーズヒータからなる。

蒸気発生ヒータ 56 とほぼ同じ高さになるように、ポット 51 の内部に伝熱ユニット 60 が配置される。

#### 【0037】

伝熱ユニット 60 は、ポット 51 の側壁内面に密着するリング 61 と、このリング 61 の内部に放射状に配置される複数のフィン 62 を備える。リング 61 と

フィン 62 は押出成形、溶接、ろう付けなどの手法により一体化されている。リング 61 及びフィン 62 はポット 51 の軸線方向に所定の長さを有する。

#### 【0038】

ポット 51 には給水パイプ 63 を通じて給水する。給水パイプ 63 はポット 51 の底部近くからポット 51 の中に入り込んだ後、下から上へとフィン 62 の間を通過して延びる。給水パイプ 63 の上端はフィン 62 の上縁より少し上に突き出している。図 6 に見られるように、フィン 62 を車輪のスポークに見立てた場合、ハブとなる位置に給水パイプ 63 が配置されている。給水パイプ 63 の外面には各フィン 62 の端面を接触させ、フィン 62 を通じて給水パイプ 63 に熱を伝える。

#### 【0039】

ポット 51、伝熱ユニット 60、及び給水パイプ 63 は熱の良導体である金属で形成する。金属としては熱伝導率の良い銅やアルミニウムが適する。但し銅や銅合金の場合、緑青が発生するので、熱伝導率は少し劣るものの、緑青を懸念せずに済むステンレス鋼を用いることとしてもよい。

#### 【0040】

給水パイプ 63 の端には漏斗状の受入口 64 が形成される。受入口 64 から少し下流の位置に洗浄パイプ 65 が接続される。洗浄パイプ 65 は洗浄バルブ 66 を介して排水パイプ 53 に接続する。

#### 【0041】

給水パイプ 63 には、洗浄パイプ 65 の他、逆 J 字形の落差形成パイプ 67 も接続される。落差形成パイプ 67 の他端は排水パイプ 53 に接続される。

#### 【0042】

水タンク室 70 には横幅の狭い直方体形状の水タンク 71 が挿入される。この水タンク 71 から延び出すエルボ形の給水パイプ 72 が給水パイプ 63 の受入口 64 に接続される。ポンプ 73 が水タンク 71 内の水を給水パイプ 72 を通じて圧送する。ポンプ 73 は、給水パイプ 72 の根元部に形成されたポンプケーシング 74 と、ポンプケーシング 74 に収容されたインペラ 75 と、インペラ 75 に動力を伝えるモータ 76 とにより構成される。モータ 76 はキャビネット 10 の

側に固定されており、水タンク 71 を所定位置にセットするとインペラ 75 に電磁的に結合する。

#### 【0043】

水タンク室 70 の床面には水タンク 71 を支えるトラフ形のレール 77 が固定されている（図 2 参照）。レール 77 のタンク載置面は水平に開いた扉 12 の内面と同じ高さにある。そのため使用者は、水平になった扉 12 の上に水タンク 71 を置き、レール 77 に向かって押し込んで行くことにより、水タンク 71 をスムーズに水タンク室 70 内の所定位置にセットすることができる。逆に、扉 12 を水平に開いておいて水タンク 71 を引き出せば、水タンク室 70 から出た水タンク 71 はそのまま扉 12 で支えられる。従って水タンク 71 を手で支えつつ引き出す必要がない。

#### 【0044】

蒸気調理器 1 の動作制御を行うのは図 7 に示す制御装置 80 である。制御装置 80 はマイクロプロセッサ及びメモリを含み、所定のプログラムに従って蒸気調理器 1 を制御する。制御状況は操作パネル 11 の中の表示部に表示される。制御装置 80 には操作パネル 11 に配置した各種操作キーを通じて動作指令の入力を行う。操作パネル 11 には各種の音を出す音発生装置も配置されている。

#### 【0045】

制御部 80 には、操作パネル 11 の他、送風装置 25、蒸気加熱ヒータ 41、ダンパ 45、排水バルブ 54、水位センサ 55、蒸気発生ヒータ 56、洗浄バルブ 66、及びポンプ 73 が接続される。この他、水タンク 71 の中の水量を測定する水量センサ 81、加熱室 20 内の温度を測定する温度センサ 82、及び加熱室 20 内の湿度を測定する湿度センサ 83 が接続されている。

#### 【0046】

蒸気調理器 1 の動作は次の通りである。まず水タンク 71 を水タンク室 70 から引き出し、図示しない給水口よりタンク内に水を入れる。満水状態にした水タンク 71 を水タンク室 70 に押し込み、所定位置にセットする。給水パイプ 72 の先端が給水パイプ 63 の受入口 64 にしっかりと接続されたことを確認したうえで、操作パネル 11 の中の電源キーを押して電源 ON にする。するとポンプ 7

3のモータ76が回転し、蒸気発生装置50への給水が始まる。この時、排水バルブ54と洗浄バルブ66は閉じている。

【0047】

水は給水パイプ63の先端から噴水のように溢れ出し、伝熱ユニット60のフィン62を濡らしつつポット51の底に落ちる。そしてポット51の底の方から溜まって行く。水位が伝熱ユニット60の長さの半ばまで達したことを水位センサ55が検知したら、そこで一旦給水は中止される。落差形成パイプ67の入口側のパイプの中の水位もポット51と同レベルに達する。

【0048】

このように所定量の水がポット51に入れられた後、蒸気発生ヒータ56への通電が開始される。蒸気発生ヒータ56はポット51の側壁を介してポット51の中の水を加熱する。ポット51の側壁が熱せられると、その熱は伝熱ユニット60に伝わり、伝熱ユニット60から水へと伝えられる。蒸気発生ヒータ56の置かれた高さで伝熱ユニット60の置かれた高さはほぼ一致しているので、蒸気発生ヒータ56から伝熱ユニット60へとストレートに熱が伝わり、伝熱効率が良い。

【0049】

複数のフィン62が放射状に配置された伝熱ユニット60は広い伝熱面積を有し、ポット51内の水は速やかに熱せられる。また、放射状に配置されたフィン62は車輪のスプークのようにポット51を内側から支えるので、蒸気発生装置50の強度が増す。

【0050】

蒸気発生ヒータ56への通電と同時に、送風装置25及び蒸気加熱ヒータ41への通電も開始される。送風装置25は気体吸込口24から加熱室20の中の気体を吸い込み、外部循環路30に気体を送り出す。気体を送り出すのに用いるのが遠心ファン26なので、プロペラファンに比べて気流の流速が速い。そのうえ、遠心ファン26を直流モータで高速回転させるので、気流の流速はきわめて速い。このため、外部循環路30を形成するパイプを断面円形でしかも小径のものとすることができる。これにより、断面矩形のダクトで外部循環路30を形成す

る場合に比べ、外部循環路 30 の表面積が小さくなる。従って内部を熱い気体が通るにもかかわらず、外部循環路 30 からの熱放散が少なくなり、蒸気調理器 1 のエネルギー効率が向上する。外部循環路 30 を断熱材で巻く場合も、その断熱材の量が少なくて済む。

#### 【0051】

この時ダンパ 45 は外部循環路 30 の第 2 パイプ 33 の入口を開き、排気口 32 を閉ざしている。気体は第 1 パイプ 31 から第 2 パイプ 33 に入り、さらに第 3 パイプ 36 を経てサブキャビティ 40 に入る。そしてサブキャビティ 40 内で蒸気加熱ヒータ 41 により熱せられた後、噴気孔 43 から下向きに噴出する。

#### 【0052】

ポット 51 の中の水が沸騰すると、 $100^{\circ}\text{C}$ 、1 気圧の飽和蒸気が発生する。飽和蒸気は蒸気吸引エジェクタ 34 のところで外部循環路 30 を通る循環気流に吸引される。エジェクタ構造を用いているので、飽和蒸気は速やかに吸い上げられ、吸い出される。エジェクタ構造のため蒸気発生装置 50 に圧力がかからず、飽和蒸気の放出が妨げられない。

#### 【0053】

後段エジェクタ 37 においては、蒸気吸引エジェクタ 34 のアウターノズル 35 から吹き出す気流にバイパス路 38 から気体が吸い込まれる。蒸気吸引エジェクタ 34 をバイパスしてその下流に気体が吸い込まれるバイパス路 38 の存在によって循環系の圧損が小さくなり、遠心ファン 26 を効率良く駆動できる。後段エジェクタ 37 を出た飽和蒸気混じりの気体は高速でサブキャビティ 40 に突入する。

#### 【0054】

サブキャビティ 40 に入った飽和蒸気混じりの気体は蒸気加熱ヒータ 41 により  $300^{\circ}\text{C}$  にまで熱せられる。この時点で気体は過熱蒸気となる。蒸気は温度上昇により膨脹し、噴気孔 43 より勢い良く噴出する。

#### 【0055】

加熱室 20 の中央部（被加熱物載置部）に吹き下ろしの気流を形成した気体はその外側で上昇し、加熱室 20 内に対流を形成する。そして再び気体吸込口 24



から吸い込まれ、外部循環路 30 を経てサブキャビティ 40 に還流する。このようにして加熱室 20 内の気体は外部循環路 30 に出ては加熱室 20 に戻るという循環を繰り返す。

#### 【0056】

時間が経過するにつれ、気体中の蒸気の割合が増して行く。量的に余剰となった気体は気体放出口 44 から加熱室 20 の外に放出される。蒸気を含んだ気体をそのままキャビネット 10 内に放出すると、キャビネット 10 内に結露が生じ、錆の発生や漏電といった好ましくない結果を招く。キャビネット 10 の外にそのまま放出すれば、台所の壁面に結露してカビが発生する。そこで、キャビネット 10 内に設けた迷路状の結露通路（図示せず）を通して蒸気を結露させてから気体をキャビネット 10 外に放出することとし、上述の問題を回避する。結露通路から流れ落ちる水は受皿 21 に導き、調理終了後、他の原因で発生する水と共に処理する。

#### 【0057】

過熱蒸気を含む気体の噴出が始まると、加熱室 20 の中の温度は急速に上昇する。加熱室 20 の中の温度が調理可能領域に達したことを温度センサ 82 が検知すると、制御装置 80 が操作パネル 11 にその旨の表示を出し、また合図音を鳴らす。調理可能になったことを音と表示により知った使用者は扉 12 を開け、加熱室 20 に被加熱物 90 を入れる。

#### 【0058】

扉 12 を開けかかると、制御装置 80 はダンパ 45 の姿勢を切り替え、第 2 パイプ 33 の入口を閉じるとともに、排気口 32 を開く。加熱室 20 の中の気体は送風装置 25 により吸い込まれ、排気口 32 から排出される。第 2 パイプ 33 の入口が閉じることにより、噴気孔 43 からの過熱蒸気の噴出がなくなるので、使用者が顔面や手などに火傷を負うということがない。ダンパ 45 は、扉 12 が開いている間中、排気口 32 を開き、第 2 パイプ 33 の入口を閉ざす姿勢を保つ。

#### 【0059】

停止中の送風装置 25 を起動して排気口 32 から排気を行うのであれば、定常の送風状態に達するまでにタイムラグが生じるが、本発明の場合、送風装置 25

は既に運転中であり、タイムラグはゼロである。また加熱室 20 と外部循環路 30 を巡っていた循環気流がそのまま排気口 32 からの排気流になるので、気流の方向を変えるためのタイムラグもない。これにより、加熱室 20 の中の蒸気を遅滞なく排出し、扉 12 の開放が可能になるまでの時間を短縮することができる。

#### 【0060】

加熱室 20 から蒸気を排出するときは第 2 パイプ 33 が閉ざされて加熱室 20 への蒸気供給が停止されている。このため加熱室 20 の内部の蒸気圧あるいは蒸気量は速やかに低下し、扉 12 の開放が可能となるまでの時間が一層短縮される。

#### 【0061】

使用者が扉 12 を開けなかったという状況は、例えば次のようにして制御装置 80 に伝えることができる。すなわち扉 12 を閉鎖状態に保つラッチをキャビネット 10 と扉 12 の間に設け、このラッチを解錠するラッチレバーをハンドル 13 から露出するように設ける。ラッチ又はラッチレバーの動きに応答して開閉するスイッチを扉 12 又はハンドル 13 の内側に配置し、使用者がハンドル 13 とラッチレバーを握りしめて解錠操作を行ったとき、スイッチから制御装置 80 に信号が送られるようにする。

#### 【0062】

気体放出口 44 から放出される気体と同様、排気口 32 から排出される気体も蒸気を大量に含んでおり、そのまま放出するのは問題である。そのため、排気口 32 から排出される気体もキャビネット 10 内に設けた迷路状の結露通路を通して水分を除去してからキャビネット 10 外に放出する。結露通路から流れ落ちる水は受皿 21 に導き、調理終了後、他の原因で発生する水と共に処理する。

#### 【0063】

ラック 22 の上に被加熱物 90 をセットし、扉 12 を閉じると、ダンパ 45 は第 2 パイプ 33 への入口を開き、排気口 32 を閉ざす姿勢に復帰する。これにより噴気孔 43 からの過熱蒸気の噴出が再開され、被加熱物 90 の調理が始まる。

#### 【0064】

約 300℃ に加熱されて噴気孔 43 から吹き下ろす過熱蒸気は被加熱物 90

に衝突して被加熱物 90 に熱を伝える。この過程で蒸気温度は 250°C 程度にまで低下する。また被加熱物 90 の表面に接触した過熱蒸気は、被加熱物 90 の表面に結露する際潜熱を放出する。これによっても被加熱物 90 は加熱される。

#### 【0065】

加熱室 20 の気体を循環させつつ被加熱物 90 を加熱するので、蒸気調理器 1 のエネルギー効率は高い。そして、過熱蒸気を含む気体がサブキャビティ 40 の底面パネル 42 にほぼパネル全面にわたり二次元的又は三次元的に分散配置された複数の噴気孔 43 から下向きに噴出するので、被加熱物 90 の上面全体に過熱蒸気が衝突する。過熱蒸気が被加熱物 90 に衝突することと、衝突の面積が広いこととが相まって、過熱蒸気に含まれる熱が素早く効率的に被加熱物 90 に伝達される。また、サブキャビティ 40 に入り込んだ気体が蒸気加熱ヒータ 41 で熱せられて膨脹することにより、噴出の勢いが増し、被加熱物 90 への衝突速度が速まる。これにより被加熱物 90 は一層速やかに熱せられる。

#### 【0066】

遠心ファン 26 はプロペラファンに比べ高圧を発生させることが可能なので、噴気孔 43 からの噴射力を高めることができる。その結果過熱蒸気の噴射距離が延び、被加熱物 90 を強力に加熱できる。遠心ファン 26 を直流モータで高速回転させ、強力に送風しているので、上記の効果は一層顕著に表れる。送風装置 25 の送風力が強いことは、扉 12 を開く際、排気口 32 から速やかに排気するのにも大いに役立つ。

#### 【0067】

下向きに吹き出した過熱蒸気は、被加熱物 90 に衝突した後、上方へと向きを転じる。蒸気、特に過熱蒸気は空気より軽いため、自然な形でこのように方向転換することとなり、これが加熱室 20 の内部に対流をもたらす。この対流により、加熱室 20 内の温度を維持しつつ、被加熱物 90 にはサブキャビティ 40 で熱せられたばかりの過熱蒸気を衝突させ続けることができ、熱を大量且つ速やかに被加熱物 90 に与えることができる。

#### 【0068】

気体吸込口 24 は加熱室 20 の側壁の下部（被加熱物 90 の高さ以下）にあり

、噴気孔 43 から噴出した蒸気は偏向することなく直進して被加熱物 90 に当たってから気体吸込口 24 に吸い込まれる。このため、被加熱物 90 への熱伝達能力は高レベルに維持される。また上から噴出した蒸気が側壁下部に吸い込まれて行くため、扉 12 を開いたとき、使用者の方に蒸気が押し寄せることが少なく、安全性が高い。

#### 【0069】

気体吸込口 24 が下向きなので、噴出する蒸気に横向きの力がさらに作用しにくくなり、蒸気の偏向を一層防止することができる。また被加熱物 90 の表面から油がはじけたりしても、それが気体吸込口 24 に吸い込まれにくく、送風装置 25 や外部循環路 30 の内面を汚さずに済む。

#### 【0070】

サブキャビティ 40 の底面パネル 42 は、上面が暗色なので蒸気加熱ヒータ 41 の放つ輻射熱を良く吸収する。底面パネル 42 に吸収された輻射熱は、同じく暗色となっている底面パネル 42 の下面から加熱室 20 に輻射放熱される。このため、サブキャビティ 40 及びその外面の温度上昇が抑制され、安全性が向上するとともに、蒸気加熱ヒータ 41 の輻射熱が底面パネル 42 を通じて加熱室 20 に伝えられ、加熱室 20 が一層効率良く熱せられる。底面パネル 42 の平面形状は円形であってもよく、加熱室 20 の平面形状と相似の矩形であってもよい。また、加熱室 20 の天井壁にてサブキャビティ 40 の底面パネルを形成（兼用化）してもよい。

#### 【0071】

被加熱物 90 が肉類の場合、温度が上昇すると油が滴り落ちることがある。被加熱物 90 が容器に入れた液体類であると、沸騰して一部がこぼれることがある。滴り落ちたりこぼれたりしたものは受皿 21 に受け止められ、調理終了後の処理を待つ。

#### 【0072】

蒸気発生装置 50 で蒸気を発生し続けていると、ポット 51 の中の水位が低下する。水位が所定レベルまで下がったことを水位センサ 55 が検知すると、制御装置 80 はポンプ 73 の運転を再開させる。ポンプ 73 は水タンク 71 の中の水

を押し上げ、蒸発した分の水を補給する。給水パイプ 63 の中を通る際、補給水には伝熱ユニット 60 のフィン 62 を通じて蒸気発生ヒータ 56 の熱が伝えられる。これにより補給水は予熱され、沸騰点に達するまでの時間が短縮される。

#### 【0073】

また給水パイプ 63 の上端から噴きこぼれる補給水は、フィン 62 の上部の水面上に露出している部分に注ぎかけられる。フィン 62 の水面上露出部分は、水中に没している部分より高熱になっているので、フィン 62 に注がれた水は瞬時に沸騰して蒸発し、ポット 51 の内部の蒸気圧を高める。このため、アウターノズル 35 から蒸気が力強く噴出してサブキャビティ 40 に流れ込み、噴気孔 43 からの過熱蒸気の噴出を加勢する。従って、給水の度に過熱蒸気の強力噴射が生じる。

#### 【0074】

ポット 51 の中の水位が所定レベルまで上昇したことを水位センサ 55 が検知した時点で、制御装置 80 はポンプ 73 の運転を停止させる。このようにしてポンプ 73 は、調理期間中、間欠的に給水動作を行う。フィン 62 の水面上露出部分は、水を注がれることにより一旦温度が低下するが、その後水が注がれなくなると温度を回復する。これにより、新たな水が注がれる度にその水は急速蒸発し、過熱蒸気の噴射力を増大させることになる。

#### 【0075】

上記実施形態では、加熱室内の気体を外部循環路を経てサブキャビティに戻すという構成を採用したが、これと異なる構成も可能である。例えば、サブキャビティに常に新しい気体を供給し、加熱室から溢れた気体を気体放出口から放出することとしてもよい。

#### 【0076】

この他、発明の主旨を逸脱しない範囲でさらに種々の変更を加えて実施することが可能である。

#### 【0077】

#### 【発明の効果】

本発明の蒸気調理器は、蒸気発生装置が発生させた蒸気を含む気体を加熱室の

天井部に設けたサブキャビティに導き、サブキャビティ内の加熱手段で加熱した気体をサブキャビティの底面に分散配置した複数の噴気孔から加熱室に噴出させるようにしたものであり、蒸気供給のための配管系統が加熱室内にむき出しにならないので視覚的に好ましく、家庭での使用に適したものとすることができる。そして、蒸気を含む気体が分散配置された複数の噴気孔から被加熱物に向け下向きに噴出するので、被加熱物の上面全体に蒸気が衝突する。蒸気が被加熱物に衝突することと、衝突の面積が広いことが相まって、蒸気に含まれる熱が素早く効率的に被加熱物に伝達される。

#### 【図面の簡単な説明】

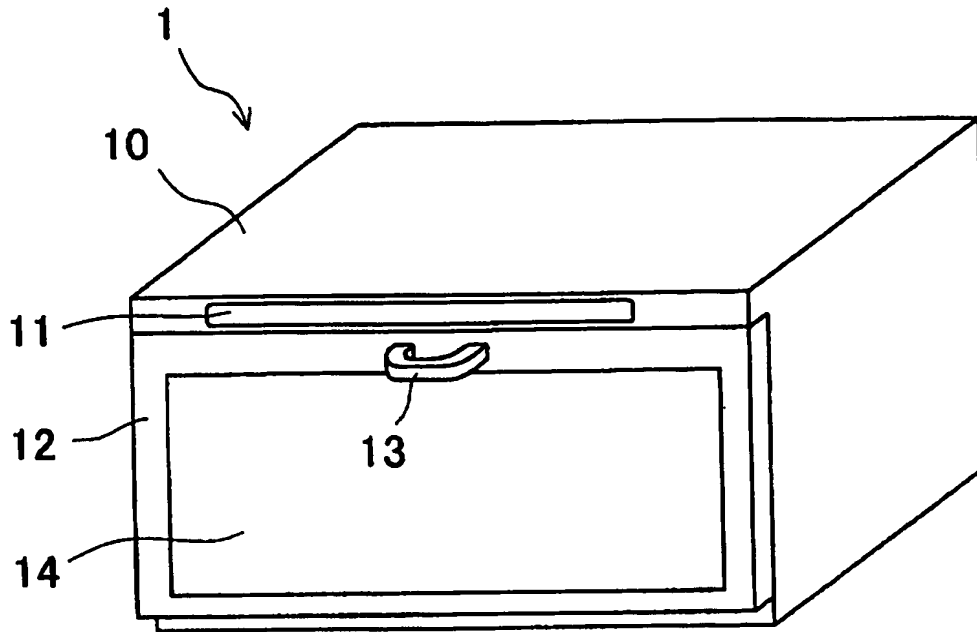
- 【図 1】 本発明の一実施形態に係る蒸気調理器の外観斜視図
- 【図 2】 加熱室の扉を開いた状態の外観斜視図
- 【図 3】 内部機構の基本構造図
- 【図 4】 加熱室の上面図
- 【図 5】 蒸気発生装置の垂直断面図
- 【図 6】 蒸気発生装置の水平断面図
- 【図 7】 制御ブロック図

#### 【符号の説明】

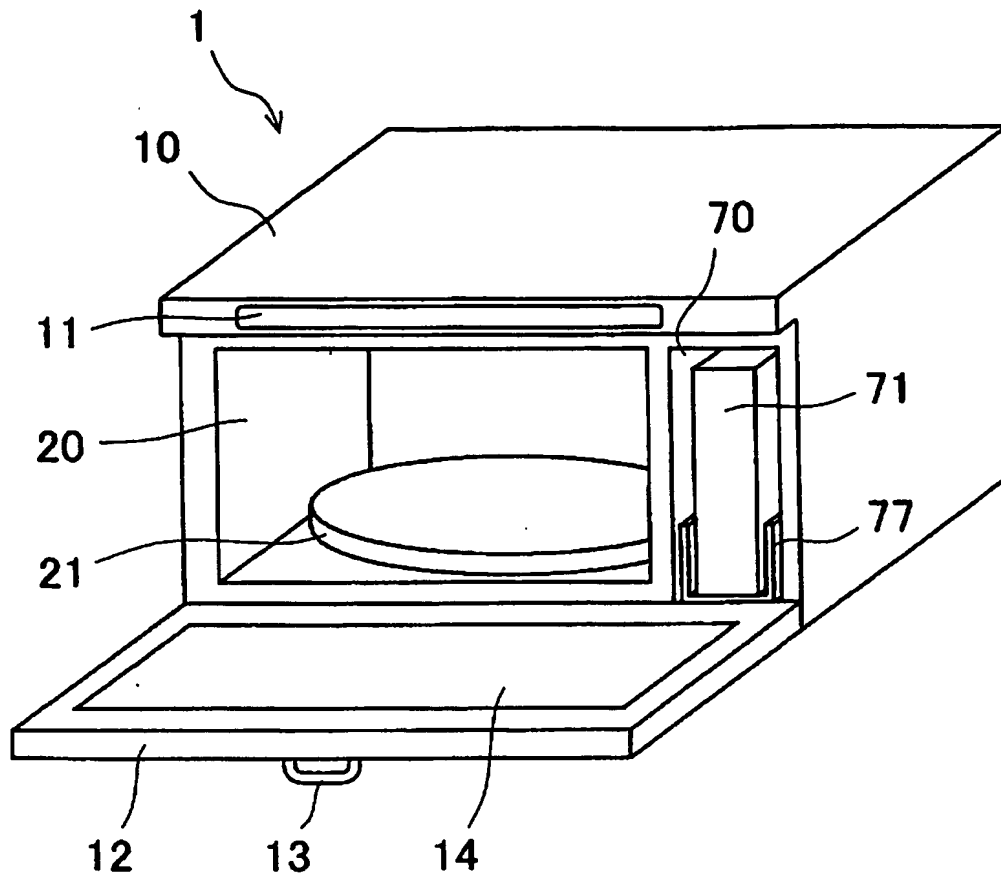
- 1 蒸気調理器
- 20 加熱室
- 21 受皿
- 24 気体吸込口
- 25 送風装置
- 30 外部循環路
- 40 サブキャビティ
- 41 蒸気加熱ヒータ
- 42 底面パネル
- 43 噴気孔
- 44 気体放出口
- 50 蒸気発生装置

【書類名】 図面

【図 1】

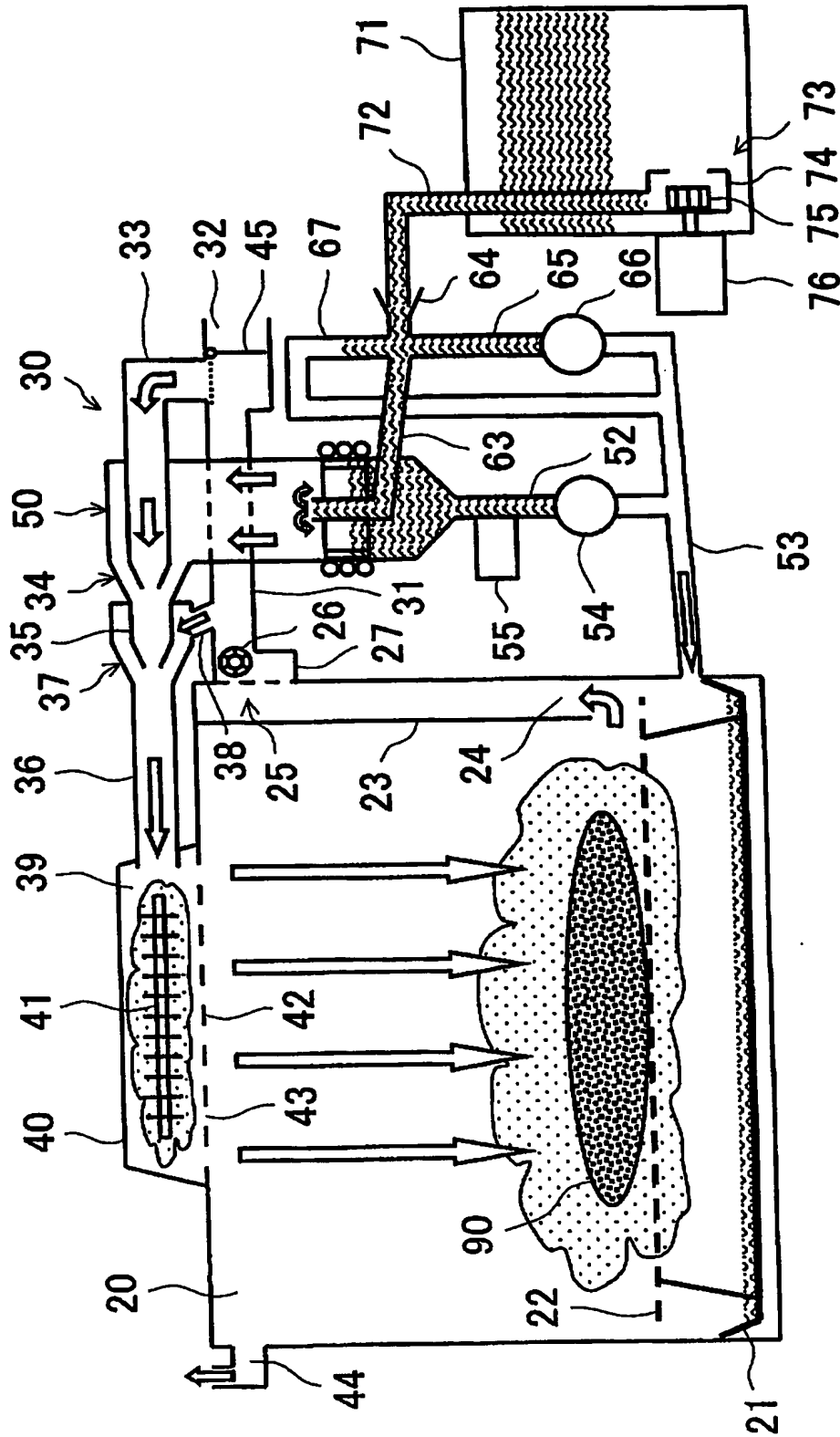


【図 2】

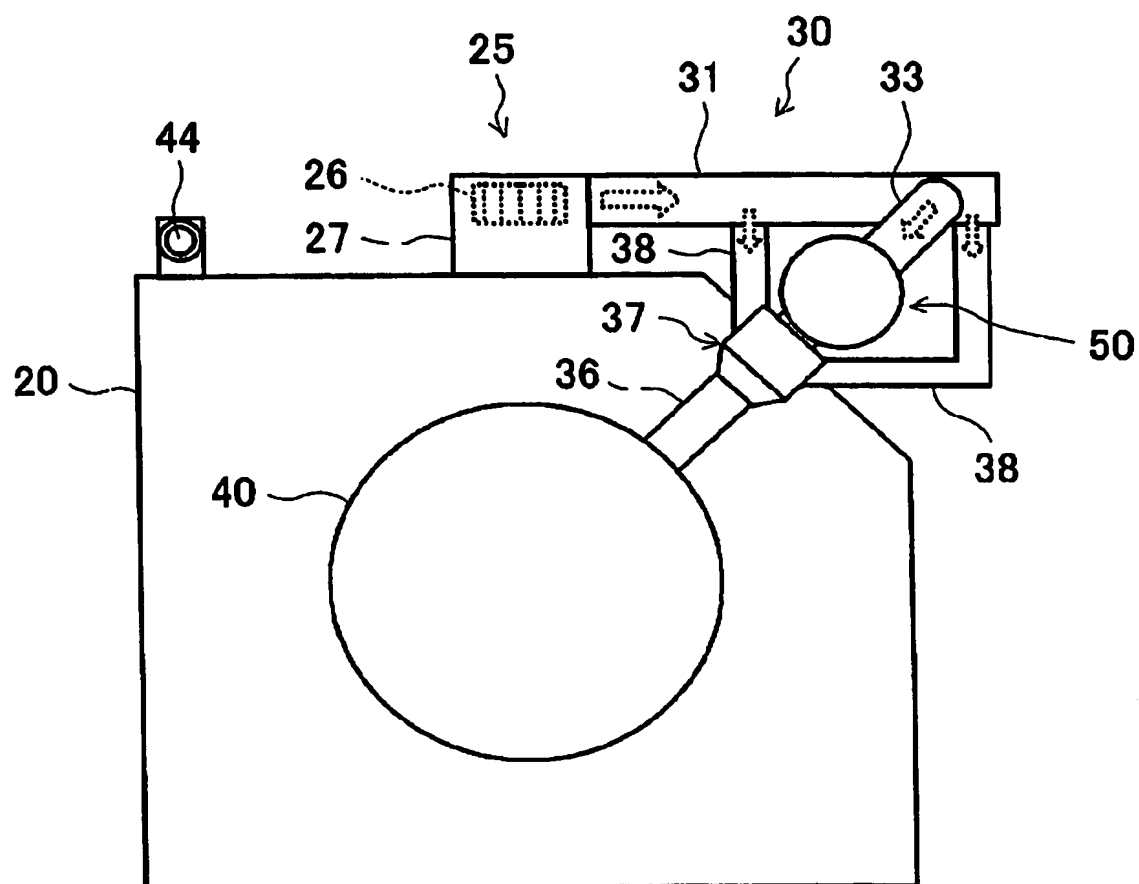




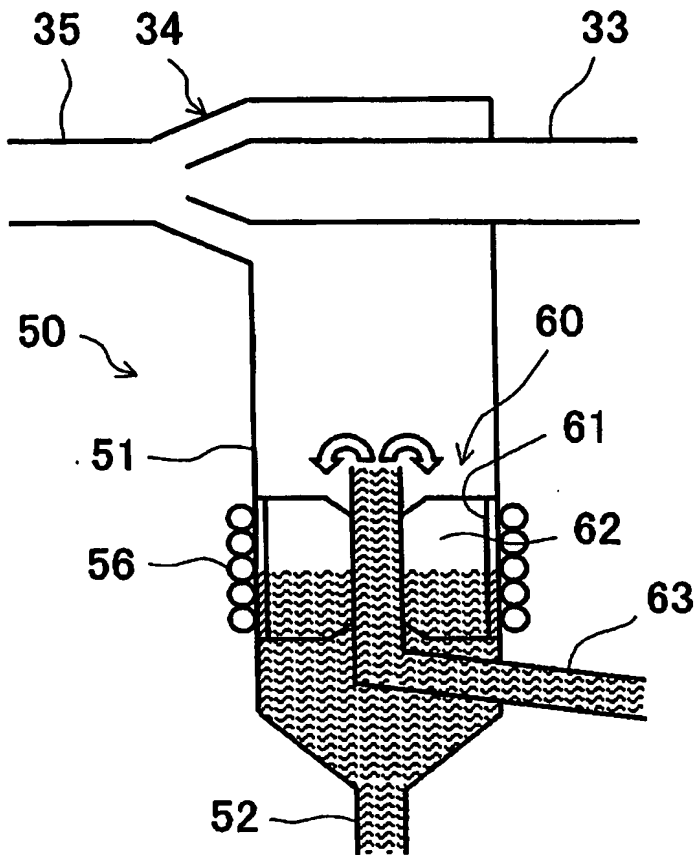
【図3】



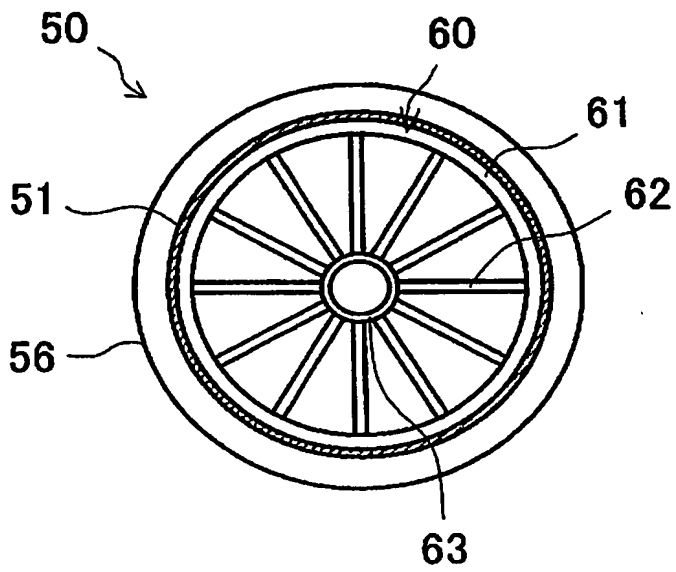
【図 4】



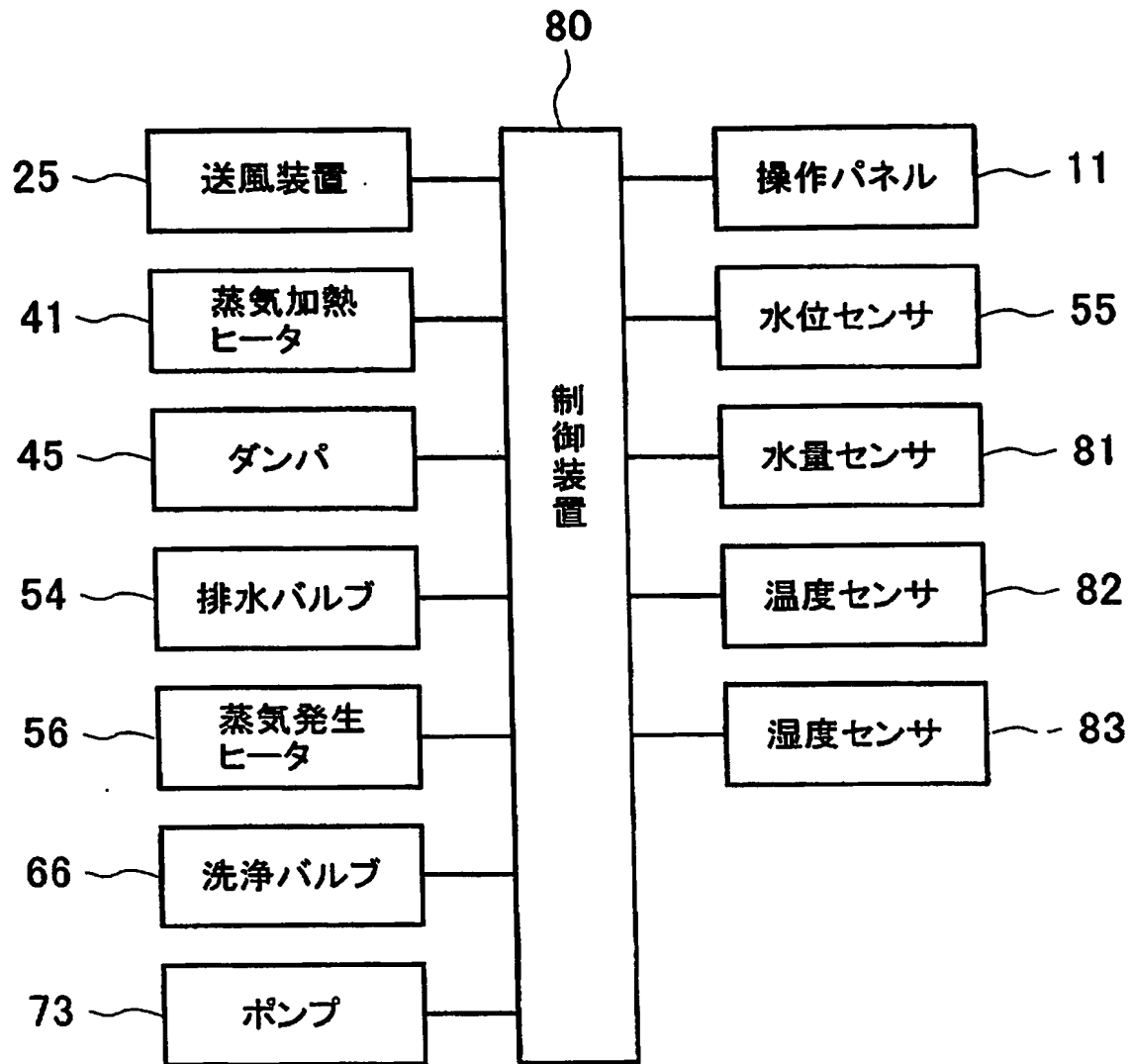
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 視覚的に好ましく家庭内使用に適すると共に、被加熱物に大量の熱を均一かつ速やかに与えることができ、加熱効率の高い蒸気調理器を提供する。

【解決手段】 加熱室 20 の天井部には蒸気加熱ヒータ 41 を内蔵したサブキャビティ 40 が設けられている。加熱室 20 の中の気体は下方を向いた気体吸込口 24 を通じて送風装置 25 に吸い込まれ、外部循環路 30 に送り込まれる。外部循環路 30 を通る気体は途中で蒸気発生装置 50 より蒸気を吸引し、外部循環路 30 からサブキャビティ 40 に入る。蒸気加熱ヒータ 41 により加熱されて過熱状態となった蒸気はサブキャビティ 40 の底面に二次元的又は三次元的に分散配置された複数の噴気孔 43 から下向きに噴出し、被加熱物 90 に衝突する。噴気孔 43 は加熱室 20 の天井部の中央部に配置されていて、加熱室 20 の中央部で蒸気の吹き下ろしが生じるとともに、その周囲では蒸気の吹き上げが生じる。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 3 - 2 0 4 1 9 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 5 0 4 9 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号

氏 名

シャープ株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**